自由分子流領域における気体潤滑特性の解析 (境界面特性の影響) 2A05

| 鳥取大・院 | (学) | *嶋田 | 英和 | 鳥取大・エ | (正) | 山根 |
|-------|-----|-----|----|-------|-----|----|
| 鳥取大・エ | (正) | 松岡 | 広成 | 鳥取大・エ | (正) | 福井 |

1. まえがき

超微小すきまの気体潤滑(分子気体潤滑(MGL)¹⁾) の適用例である磁気ディスク装置の浮動ヘッドでは、 すきま量の更なる微小化に伴って 10 nm 程度以下の 超微小すきま領域の潤滑特性、面粗さを考慮した場 合に局所的に生じる数nmのすきまにおける特性の把 握が望まれている。この場合の潤滑領域の流れは、着 目する領域の代表長h。が気体の分子平均自由行程 λ よりも小さいことから($h_0 << \lambda_n$ したがってクヌッセ ン数Kn λ/h_>>1) 分子相互の衝突よりも分子と境 界壁との衝突が主となる"自由分子流 (Free Molecular Flow) "に近い状態となっている^{2,3)}。この自由分子 流は、分子気体の性質がわずかな "スリップ流れ "の 近似の反対の極限として、扱いが簡単になる。

本報告では、MGL 解析と自由分子流を仮定した 「自由分子流MGL方程式」による解析の結果を比較 した。比較は境界面の特性を変化させて行い、具体 的には、3種の基本形状について、境界面における気 体分子の反射の形態を表す適応係数 αをパラメータ として、その影響を定量的に調べた。

2. 自由分子流領域における分子気体潤滑方程式 境界面の適応係数 α を考慮した分子気体潤滑 (MGL)方程式は、次式で表される。

$$\frac{d}{dX}\left\{\tilde{Q}_{P}(D,\alpha_{0},\alpha_{1})PH^{3}\frac{dP}{dX}\right\} = \Lambda \frac{d\left\{Q_{C}(D,\alpha_{0},\alpha_{1})PH\right\}}{dX}$$
(1)

ここで、P,Hは無次元圧力、無次元すきまであり、D は逆クヌッセン数(= $ph/u\sqrt{2RT}$)である。また、 \tilde{O}_{p} はポアズイユ流れの流量係数比であり、ポアズイユ 流れの流量係数 Q_p を連続流の値D/6で割った値 $(Q_p/$ (D/6))である。

自由分子流領域では壁面の適応係数 αが任意の場 合、ポアズイユ流れの流量係数*Q*,は、次の自由分子 流の流量係数 Q_{Pfm} で近似できる。

$$Q_{Pfm}(D) = -\frac{1}{\sqrt{\pi}} \alpha_P \log(D)$$
⁽²⁾

ここで、 α_p は次式である。

$$\alpha_{P} = \frac{(2 - \alpha_{0})(2 - \alpha_{1})}{1 - (1 - \alpha_{0})(1 - \alpha_{1})}$$
(3)

また、 α_{μ} は走行面 (ディスク)の適応係数、 α_{μ} は静 止面(スライダ)の適応係数である。

以下では、上下面の適応係数が等しい場合($\alpha_{a}=\alpha_{a}=\alpha$)

清美 茂寿

を取り扱う。この場合には $\alpha_p = (2-\alpha)/\alpha$ となり、こ れを用いると式(1)は次式となる。

$$\frac{d}{dX}\left(\log(D)H^2\frac{dP}{dX}\right) = -\frac{\sqrt{\pi}D_0}{6}\frac{\Lambda}{\alpha_p}\frac{d(PH)}{dX}$$
(4)

特に、 $\alpha = 1$ の場合には $\alpha_p = 1$, すなわち $Q_{Pfm}(D) =$

式(4)を、任意の適応係数に対する自由分子流 MGL 方程式 (Free molecular MGL eq.)と呼び、以 下の解析で用いる。

3. 解析結果

i)流量係数Q,と自由分子流の流量係数Q,,,の比較

図1は、適応係数αが0.2~1の場合について、ポ アズイユ流れの流量係数 Q, と自由分子流の流量係 数 Q_{Pfm} を比較したものである。



ii)解析対象

図2は、解析対象とした傾斜平面形スライダ(a)お よびステップ形スライダ(b)で、形状パラメータとし てそれぞれ傾き β , ステップ量 δ をとる。以下では、 (a)傾斜平面形(β=1), (b-1)正ステップ形(δ=1), (b-2) 逆ステップ形(δ =-0.5)の3つの形状を対象とした解 析結果を述べる。

(社)日本トライボロジー学会トライボロジー会議予稿集 (宇都宮 2001-11)



iii)適応係数の影響

図3は、いずれも基準すきま量 h₀=5nm とし適応係 数αを変化させた場合の圧力分布である。いずれの形 状においても、αの減少に伴い発生圧力が減少する。

iv)MGL解析と自由分子流MGL解析の結果の比較

図4は、 $\alpha = 0.8$ 、基準すきま量 h_0 が20nm, 5nm, 1nm の場合について、MGL解析と自由分子流MGL解析 の結果を比較した。 $\alpha = 1$ の場合と同様に、いずれの形 状もすきまが微小である程、両者がよく一致する $^{\circ}$ 。 v)負荷容量と圧力中心の解析結果

図5は、図3(a)の発生圧力から負荷容量を算出し、 適応係数を横軸として表したものである。 α が1に 近づくにつれて、負荷容量も増加する。なお、圧力 中心 \bar{x} についても、 α が1に近づくにつれて、 \bar{x} が出 口すきまの方に移動することを確認した。

4. まとめ

本研究では、分子気体潤滑(MGL)理論に基づき、 適応係数αを考慮した自由分子流領域の圧力の解析 手法を確立した。また、この手法を用いて、種々の 形状のスライダの圧力をいくつかの適応係数につい て求め、MGL 解析と比較を行った。

また解析結果から、適応係数 α=1 ~ 0.8 程度です きま量が数 nm 程度以下では、式(1)の MGL 方程式



の結果と式(4)の自由分子流MGL方程式の結果がよく 一致することを確認した。

参考文献

1) Fukui, S. and Kaneko, R., *Handbook of Micro/Nano tribol*ogy, ed. Bhushan, B., CRC Press (1995), Chap. 13

2) 丹生、流体物理学、共立全書 219、共立出版 (1978)

3) 曽根·青木、分子気体力学、朝倉書店 (1994)、2章

4) Cercignani, C. and Daneri, A., *J. Appl. Phys.*, Vol. 34 (1963), pp. 3509-3513

5) Fukui, S. & Kaneko, R., *ASME J. Tribology*, Vol. 118 (1996), pp. 364-369

6) 山根清美,嶋田英和,松岡広成,福井茂寿,自由分子流 領域における気体潤滑特性の解析,日本機械学会 IIP2001 講演論文集 (2001), pp. 40-42